



大気圧環境で選択的な官能基付与を実現

大気圧下で溶媒を用いず撥水化処理を可能にする

SAIMOS ty シリーズ

製品の特徴

SAIMOS (Self-Assembling Integrated MOlecular Structures) は、大気圧プラズマ技術を超えた革新的な表面改質プロセスです。溶媒や触媒を必要とせず廃液処理が不要なため、環境負荷や健康リスクを軽減します。撥水化や接着強化など多様な処理が可能で、食品・医薬品容器、自動車、電子部品など幅広い分野に応用可能です。持続可能な生産プロセスを実現し、次世代の表面改質技術として注目されています。



製品が誕生した背景

当社は数年前にドライ環境下でSAM (Self-Assembled-Monolayer、自己組織化単分子膜) 形成が可能な真空プラズマ技術を開発し、受託処理や装置納入を行って参りました。その過程で、大気圧環境下でも表面に任意の官能基を付与する技術開発の要求が高まりました。特に、撥水化や接着強化といった機能を環境負荷なく実現する技術が求められていました。これを受けて、溶媒や触媒を使用せずに大気圧環境下で表面に特定の官能基を付与できる技術の開発に着手しました。そして、持続可能な生産と多用途性を実現する「SAIMOS」の誕生に至りました。

こんな時に活用できます！

SAIMOSは、食品・医薬品容器の撥水加工や、自動車・電子部品の接着強化前処理に活用可能です。大気圧環境下で処理が可能のため、生産ラインへの組み込みが容易で、効率的な生産を実現します。また、局所排気の軽微なユーティリティで済み、対象物のサイズに制限がない点も大きなメリットです。

株式会社魁半導体

〒600-8897 京都市下京区西七条御前田町50 SAKIGAKE

TEL 075-204-9589

FAX 050-3488-5833

URL <https://sakigakes.co.jp>

EMAIL m.hukumori@sakigakes.co.jp

表面改質装置などを含む、プラズマを用いた半導体製造装置の開発を主に行っています。また、製造販売委託研究による半導体製造装置の開発及び製造販売、各種材料・加工品の販売、堆積・エッチング代行も行っています。